## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-129946

(43)Date of publication of application: 19.05.1995

(51)Int.Cl.

G11B 5/66

(21)Application number : 05-277687

(71)Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

(22)Date of filing:

08.10.1993

(72)Inventor: ANDO TOSHIO

MIZUKAMI MAKOTO

(30)Priority

Priority number : 05251178

Priority date: 13.09.1993

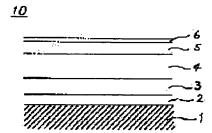
Priority country: JP

### (54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the demagnetization of a medium due to turning, to reduce medium noise, to attain high reproduction output and to obtain a perpendicular magnetic recording medium having high performance and high quality.

CONSTITUTION: A soft magnetic underlayer 4 and a perpendicular magnetic recording layer 5 are successively formed on a discoid substrate 1 to obtain a perpendicular magnetic recording medium 10, a hard magnetic underlayer 3 having magnetization whose entire direction is toward the periphery or center of the substrate 1 in the radial direction is interposed between the substrate 1 and the soft magnetic underlayer 4.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.09.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2947029

[Date of registration]

02.07.1999

http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAT9ayZlDA407129946P1.htm

6/9/2006

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平7-129946

(43)公開日 平成7年(1995)5月19日

(51) Int.Cl.6

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 5/66

9196-5D

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平5-277687

(22)出願日

平成5年(1993)10月8日

(31)優先権主張番号 特願平5-251178

(32)優先日

平5 (1993) 9月13日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000004329

日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

(72)発明者 安藤 敏男

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地 日本ピクター株式会社内

(72)発明者 水上 誠

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地 日本ピクター株式会社内

#### (54) 【発明の名称】 垂直磁気記録媒体

#### (57)【要約】

【目的】 媒体の回転による減磁を防止し、媒体ノイズ を低減し、高い再生出力を得ることが出来るようにし、 それにより、高性能且つ高品質な垂直磁気記録媒体を提 供する。

【構成】 円板状の基板1と、この基板1上に形成され た軟磁性下地層4と、この軟磁性下地層4上に形成され た垂直磁気記録層5とを備えた垂直磁気記録媒体10に おいて、前記基板1と前記軟磁性下地層4との間に、全 ての磁化方向が前記基板1の半径方向の外周向き或いは 中心向きのいずれかである磁化を有する硬磁性下地層 3 を設けた。

<u>0</u>	
	6
	-4
	1

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】円板状の基板と、この基板上に形成された 軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直 磁気記録層とを備えた垂直磁気記録媒体において、

前記基板と前記軟磁性下地層との間に、全ての磁化方向 が前記基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいず れかである磁化を有する硬磁性下地層を設けた事を特徴 とする垂直磁気配録媒体。

【請求項2】円板状の基板と、この基板上に形成された 軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直 10 磁気記録層とを備えた垂直磁気記録媒体において、

前記基板と前記軟磁性下地層との間に、全ての磁化方向 が前記基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいず れかであって配向方向が前記基板の面内である面内配向 硬磁性下地層を設けた事を特徴とする垂直磁気配録媒

【請求項3】円板状の基板と、この基板上に形成された 軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直 磁気記録層とを備えた垂直磁気記録媒体において、

記基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいずれか であって配向方向が前記半径方向である半径配向硬磁件 下地層を設けた事を特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項4】請求項3に記載の垂直磁気記録媒体であっ て、前記半径配向硬磁性下地層をSm (サマリュウム) を含むCo合金膜とした事を特徴とする垂直磁気記録媒

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、垂直磁気配録媒体に係 り、特に軟磁性下地層を有する2層膜媒体に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】垂直磁気記録は、面内磁気記録よりも高 密度記録ができることから注目されており、これに用い る媒体としては、非磁性基板上に形成された軟磁性下地 層と垂直磁気記録層とからなる2層膜媒体が多く検討さ れている。このような2層膜媒体は、単磁極型ヘッドと 組み合わせることにより、効率の良い磁気記録再生がで きる。中でも、Co-2r系アモルファス軟磁性膜を下 地層とする2層膜媒体は、垂直配向性の鋭い垂直磁気記 録層を得ることができるため、記録効率の向上には特に 有効である。

【0003】しかし、この2層膜媒体をディスク状の媒 体として用いる場合には、信号記録後に、媒体を回転さ せているだけで時間とともに減磁して、信号強度が減衰 してしまうという問題がある。この減磁現象は、媒体が 回転する際に、地磁気等の外部磁界の影響により、アモ ルファス軟磁性下地層の磁化が容易に反転し、これに伴 う強い垂直磁界を発生する磁壁の移動により、垂直磁気 50 記録層の記録情報が消去されるためと考えられている。

【0004】そこで、本願出願人は先に、特願平4-1 03490号において、上記軟磁性下地層の上に針状粒 子を形成して表面に凹凸をつけることによって、減磁を 解消する方法を提案した。これを第1の従来例として説 明する。図3は、係る第1の従来例及び第2の比較例の 垂直磁気記録媒体の構成を模式的に示す部分断面図であ る。同図において、21は鏡面研磨した円板状のガラス 基板であり、このガラス基板21の上には、例えばCo - 2 r を含むアモルファスの薄膜よりなる軟磁性下地層 24が形成されている。そして、この軟磁性下地層24 の表面には、多数の針状粒子27が形成される。この針 状粒子27としては軟磁性下地層24の構成材料である Co-Zr系合金と固溶しにくい材料、例えばCu、S n、Zn、A1、Cd、Pb等の金属やホイス力を形成 し易いものを用いる。そして、この針状粒子27の上に 垂直磁気記録層25が形成され、この垂直磁気記録層2 5の上には保護層26が形成された構成になっている。

【0005】そして、このような構成の垂直磁気記録媒 前記基板と前記軟磁性下地層との間に、全ての磁化が前 20 体12では、軟磁性下地層24の磁壁の移動が、針状粒 子27の存在により抑制されるため、軟磁性下地層24 の保磁力Hcをある程度大きくすることができ、外部磁 界の影響による経時変化を抑えることができ、従って減 磁の問題を解消する事ができる。

> 【0006】また、本顧出願人はさらに、特願平5-6 3528号において、上記軟磁性下地層と基板との間に カーポン層を設けた後、真空中で熱処理することによっ て、減磁を解消する方法も提案した。これを第2の従来 例として説明する。図9は、第2の従来例の垂直磁気記 録媒体の構成を模式的に示す部分断面図である。同図に おいて、31は鏡面研磨した円板状のガラス基板であ り、このガラス基板31の上には、例えば50nmの膜 厚のクロム層32が形成されている。このクロム層32 の上には、カーボン層37が形成されている。このカー ポン層37の上には、例えばCo-2r-Nb系のアモ ルファスの薄膜よりなる軟磁性下地層34が形成されて いる。そして、この軟磁性下地層34の上には、例えば Co-Cr-Ta系のアモルファス薄膜よりなる垂直磁 気記録層35が形成され、この垂直磁気記録層35の上 には、例えばSIO2 よりなる保護層36が形成されて いる。このような構成を有する垂直記録媒体13を、真 空中で、回転磁界を作用させながら、熱処理を行う。

【0007】 このようにして得られる垂直磁気記録媒体 13においては、カーボンが、軟磁性下地層34中に拡 散されることにより、軟磁性下地層34の結晶化温度が 低くなり、比較的低温の熱処理により軟磁性下地層34 の結晶化を制御して、その保磁力(Hc)を適度な値に 上昇することができるため、減磁を生じない垂直磁気記 録媒体13を得ることができる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、以上説明した方法は、いずれも軟磁性下地層の抗磁力(Hc)を高くすることによって、媒体回転に伴い発生する減磁を防止するものである。軟磁性下地層のHcを高くする事は、この軟磁性下地層の透磁率μを低下させる事になり、垂直配録媒体からの高い再生出力を得るには不利となる。また、軟磁性下地層と垂直磁気記録層とから構成される垂直磁気記録媒体においては、軟磁性下地層に磁壁が存在するため、この磁壁に起因する媒体ノイズが発生する。

【0009】そこで、本発明は上記の点に着目して、垂 直磁気記録媒体において、媒体の回転による減磁を防止 し、媒体ノイズを低減し、高い再生出力を得ることが出 来るようにし、それにより、高性能且つ高品質な垂直磁 気記録媒体を提供することを目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】請求項1による本発明の 垂直磁気記録媒体は、円板状の基板と、この基板上に形成された軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直記録層とを備えた垂直磁気記録媒体において、 前配基板と前記軟磁性下地層との間に、全ての磁化方向 が前記基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいず れかである磁化を有する硬磁性下地層を設けた事によ り、上述の目的を達成するものである。

【0011】また、請求項2による本発明の垂直磁気記録媒体は、円板状の基板と、この基板上に形成された軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直磁気配録媒体において、前記基板と前配軟磁性下地層との間に、全ての磁化方向が前配基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいずれかで 30あって配向方向が前記基板の面内である面内配向硬磁性下地層を設けた事により、上述の目的を達成するものである。

【0012】また、請求項3による本発明の垂直磁気記録媒体は、円板状の基板と、この基板上に形成された軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直磁気配録関とを備えた垂直磁気記録媒体において、前記基板と前記軟磁性下地層との間に、全ての磁化が前記基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいずれかであって配向方向が前記半径方向である半径配向硬磁性下地層を設けた事により、上述の目的を達成するものである。

【0013】また、請求項4による本発明の垂直磁気記録媒体は、請求項3に記載の垂直磁気記録媒体であって、前記半径配向硬磁性下地層をSm (サマリュウム)を含むCo合金膜とした事により、上述の目的を達成するものである。

[0014]

【実施例】以下、添付図面を参照して本発明の実施例に ついて説明する。

<実施例1>図1は、本発明の垂直磁気記録媒体の第1 50 ここで直ちに成膜することにより、Co-2 ${ ext{r}}$   ${ ext{-N}}$   ${ ext{b}}$   ${ ext{-}}$ 

の実施例の構成を模式的に示す部分断面図である。同図に示すように、この垂直磁気記録媒体10は、鏡面研磨した円板状のガラス基板1と、このガラス基板1の上に順に形成されたクロム層2、硬磁性下地層3、軟磁性下地層4、垂直磁気記録層5及び保護層6とから構成されている。

【0015】以下、本発明の実施例1についてその具体 的な製造方法を説明する。ガラス基板1に形成する各層 2、3、4、5、6の成膜は、図7にその電極付近の概 10 略断面図を示したごときDCマグネトロンスパッタ装置 を用いておこなった。この装置では、例えばCo-Zr -Nbのごときターゲット43の下方中央部には、第1 の希土類永久磁石41が、ターゲット43の下方外周部 には第2の希土類永久磁石42が配置されており、これ ら第1と第2の希土類永久磁石41、42の極性は、図 7中に示したようにそれぞれ逆にしてある。また、ター ゲット43の上方には、鏡面研磨した円板状のガラス基 板1が配置されている。このような配置によって、ガラ ス基板1は前記した第1と第2の希土類永久磁石41、 42によって常にその半径方向に約4kA/mの磁界が 加えられる構成になっている。なお、これらの希土類永 久磁石41、42はマグネトロンの磁石としても作用 し、ターゲット43近傍のプラズマを集束させてハイレ ートで成膜することにも寄与するものである。

【0016】また、この装置による成膜条件は、ガス圧 0.067PaのAr雰囲気で、電力密度を1.0~2.0W/cm²、ターゲット-基板間距離を60mm、基板温度を150℃~250℃とした。なお、ターゲット43は硬磁性下地層3用として直径203mmのCo-Cr15-Ta4at%合金を使用し、軟磁性下地層4用として直径203mmのCo-Zr7-Nb5at%合金を使用し、垂直磁気記録層5用として同サイズのCo-Cr15-Ta4at%合金を使用し、保護層6用として同サイズのSiOzを使用した。

【0017】まず、直径95mmの鏡面仕上げのソーダライムガラス基板1上にクロム層2を50乃至100nmの膜厚で成膜し、その上に、Co-Cr15-Ta4at%合金をターゲット43として硬磁性下地層3を25乃至200nmの膜厚で成膜した。クロム層2は、硬磁性下地層3の磁化を面内配向させるために設けたものである。なお、実際には、記録再生特性及び磁気特性に対する硬磁性下地層3の膜厚依存性を見るために硬磁性下地層3の膜厚について、25nm、50nm、100nm、200nmの各膜厚のサンブルをそれぞれ複数個製作した。

【0018】次いで、Co-Zr7-Nb5 at%合金をターゲット43として軟磁性下地層4を500nm成膜後、直ちにCo-Cr15-Ta4 at%合金をターゲット43として垂直磁気配録層5を75nm成膜した。ここで直ちに成膜することにより、Co-Zr-Nbと

Co-Cr-Taとが直接結合し、強く垂直配向する垂 直磁気記録層5が得られる。最後に保護層6としてSI O2 を10nm形成した。このようにして成膜を終えた 後、磁界中熱処理を行った。図8は、垂直磁気記録媒体 10の製造工程の1つである磁界中熱処理を説明するた めの概念図である。図8に示すように、10-3Pa以下 の真空中雰囲気において、24kA/mの磁界中で成膜 後の垂直磁気配録媒体10をその回転中心軸9の回りに 回転させながら、300℃で、3時間の熱処理を行なっ て、垂直磁気配録媒体10を得た。

【0019】ここで、本実施例1と特性比較するため に、比較例1及び2の垂直磁気記録媒体を製作した。比 較例1の垂直磁気配録媒体11は、図2に示すように構 成されており、ガラス基板1と、この上に順に形成され た軟磁性下地層4、垂直磁気記録層5及び保護層6とか らなる。各層4、5、6の材質及び成膜条件は、上述の 実施例1の場合と同一である。

【0020】比較例2の垂直磁気記録媒体12は、図3 に示した第1の従来例と同一の構成とした。 具体的に 6及び針状粒子27を成膜ないし形成するために、上述 した図7に示される構造のDCマグネトロンスパッタ装 置を使用した。ターゲット43は、軟磁性下地層24用 として、直径203mmのCo-Zr7-Nb5 at% 合金上に、不純物としてのCu (7×7×1mm) をエ ロージョンエリア上に16個配置したものを用い、また 垂直磁気記録層25用として、同サイズのCo-Cr15 -Ta4 at%合金を用い、保護膜26用として、同サ イズのSi〇2 を用いた。基板21としては、直径95 mmの鏡面仕上げしたソーダライムガラスを用いた。

【0021】成膜条件は、ガス圧0.067PaのAr 雰囲気とし、電力密度を1.0~2.0W/cm²と し、ターゲットー基板間距離を60mmとし、基板温度\* \*を150℃とした。まず、ガラス基板21上に、軟磁性 下地層24を500nmの厚さに形成し、直ちに垂直磁 気記録暦25を75nmの厚さに形成し、その後保護層 26を20nmの厚さに形成し、垂直磁気記録媒体12 を得た。なお、軟磁性下地層24を形成するとき、ター ゲット43には、針状粒子27形成用の不純物としての Cuが配置されているので、軟磁性下地層24の表面に は多数のCu針状粒子27が形成されてる。

【0022】次に、これらのサンプル(実施例1、比較 10 例1及び比較例2)の特性評価結果について説明する。 まず、記録再生特性について述べる。なお、これらのサ ンプルについての記録再生特性は、トラック幅8 µm、 主磁極厚0. 4 μm、コイル巻数60ターンの単磁極へ ッドを用い、ディスク回転数2070rpm、線速度8 m/s、ヘッド浮上量80nmの条件で測定を行なっ

【0023】100kHzの矩形波信号を記録再生し、 オシロスコープによって孤立波再生出力Ep., (n V/ (µm·t·m/s))を測定した。ここで、再生出力 は、軟磁性下地層24、垂直磁気記録層25、保護層220は、トラック幅(μm)、コイル巻数(t)及び線速度 (m/s) で、規格化してある。6.67MH2の信号 を記録再生し、そのときのノイズ成分とシステムノイズ との差分を、帯域16MH2にわたってスペクトルアナ ライザにより測定し、媒体ノイズ (μ V, ι, ) を得た。 また、垂直磁気配録媒体を回転開始した直後の再生出力 と、2×10'回転後の再生出力の比を減磁量 (dB) とした。一方、垂直磁気記録媒体の磁気特性について は、VSMで評価した。各試料につき、M-H曲線を測 定し、軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合層の透磁率μ 30 を得た。以上の測定結果を、表1に示す。

> [0024] 【表1】

特性	E <sub>p-p</sub>	・ノイズ	減磁量	透磁率μ
試料	(n∇/(µm·t·m/5))	(µV <sub>rms</sub> )	(dB)	(注1)
実施例1	118	1.4	0.13	2500
比較例1	120	1.8	4.5	3000
比較例2	77	2.8	0.14	1500

注1:硬磁性下地層/軟磁性下地層からなる複合層の1MHzにお ける透磁率を示す。

従って、比較例1及び2は軟磁性下地層の透磁率である。

【0025】表1によれば、本発明の実施例1の垂直磁 気記録媒体10は、硬磁性下地層3を有しない比較例1 に対して、再生出力は同等であるが、媒体ノイズは低下 しており、結果として、S/Nが改善されており、減磁

量を改善した比較例2と同等である。なお、透磁率につ いては、本発明の実施例1においては、下地層が軟磁性 下地層4のみからなる比較例1より劣るものの、針状粒 子を形成した比較例2より高い値を示している。

量については測定限界程度にまで改善されており、減磁 50 【0026】次に、軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合

層のM-H(磁化)曲線を説明する。図5は、本発明の 垂直磁気記録媒体の第1の実施例を構成する軟磁性下地 層4/硬磁性下地層3の複合層のM-H曲線を示すグラ フ図であり、横軸は印加磁界の強度を、縦軸は磁化を、 曲線1、mは飽和磁化曲線を、曲線n1、n2、n3は マイナーループをそれぞれ示す。なお、このM-H曲線 の測定は基板の面内方向に磁界を印加して行ったので、 垂直磁気記録層5があっても、この垂直磁気記録層5 は、基板面に垂直方向に強い異方性を持つため、以下に 述べる測定結果に影響を与えない事が分かっている。

【0027】まず、磁化されていない複合層に、正方向に増加する磁界Hを印加すると、図に示されていない初磁化曲線を辿り、正方向に磁化され、硬磁性下地層3を正方向に充分飽和する磁界強度である5000eでA点に達し、磁化Mは正方向に飽和する。次に、印加磁界Hを減少させると、磁化Mは曲線mを辿り減少していく。磁界Hが0に達すると、今度は負方向に磁界Hを増加させていく。磁界Hが一Hc (抗磁力)に達すると、磁化Mは0となる。さらに、負方向に磁界Hを増加させると、複合層は負方向に磁化され、磁界Hが一H1 (反転20磁界とする)になるとB点に達する。

【0028】次に、B点において磁界を反転し、正方向に磁界Hを変化させていくと、M-H曲線はマイナーループを描き、曲線n1に沿って磁化Mは変化していく。そして、磁化Mが0となったときの磁界HをHをHm(H1)として求める。さらに磁界Hを正方向に変化させていくと、正方向に磁化され、C点を経て、磁界Hが5000eになると再びA点に達する。この操作を繰り返し、正の飽和磁界から磁界Hを-H2まで減少させ、そこで正方向に変化させると曲線n2とHm(H2)、正30の飽和磁界から磁界Hを-H3まで減少させ、そこで正方向に変化させると曲線n3とHm(H3)が得られる。なお、負方向に充分飽和する磁界強度は、-5000eでD点で示される。

【0029】一方、図6に、第2の比較例の垂直磁気記録媒体12を構成する軟磁性下地層4のM-H曲線を示す。同図において、横軸は印加磁界の強度を、縦軸は磁化を、曲線r、sは飽和磁化曲線を、曲線t1、t2、t3はマイナーループをそれぞれ示す。なお、垂直磁気記録層25の測定に与える影響は、上述の本発明の実施40例と同様に無視できる。

【0030】まず、磁化されていない針状粒子27を含む軟磁性下地層24に、正方向に増加する磁界Hを印加すると、図に示されていない初磁化曲線を辿り、正方向に磁化され、軟磁性下地層24を正方向に充分飽和する磁界強度である5000eでA′点に達し、磁化Mは正方向に飽和する。次に、印加磁界Hを減少させると、磁化Mは曲線sを辿り減少していく。磁界Hが0に達すると、今度は負方向に磁界Hを増加させていく。磁界Hが一Hc(抗磁力)に達すると、磁化Mは0となる。さら 50

に、負方向に磁界Hを増加させると、軟磁性下地層24 は負方向に磁化され、磁界Hが-H1′(反転磁界とす る)になるとB′点に達する。

8

【0031】次に、B点において磁界を反転し、正方向に磁界Hを変化させていくと、M-H曲線はマイナーループを描き、曲線 t 1に沿って磁化Mは変化していく。そして、磁化Mが0となったときの磁界HをHm(H1')として求める。以下、上述の本実施例1の複合層の場合と同様に測定した。

10 【0032】このようにして、反転磁界Hと、反転磁界Hの時の磁化が0になる磁界Hm(H)との関係を求めたのが、図4であり、同図は、軟磁性下地層/硬磁性下地層の磁化曲線における規格化した印加(反転)磁界H/Hc(このHcは抗磁力である)とマイナーループのHm(H)との関係を示すグラフ図である。図4においは、複合層の硬磁性下地層3の膜厚を、25nm、50nm、100nm、200nmとしたときの結果と、比較例2の結果とを示してある。

【0033】本発明の実施例1のM-H曲線を示す図5において特徴的なのは、Hm (H) が負になっていることである。これは、図4において、Hm (H) が負の領域にラインが存在する事に相当する。図5には、A、B、C各点における磁化の方向を四角枠内の矢印で示してあり(上段は軟磁性下地層4、下段は硬磁性下地層3の磁化の方向をそれぞれ示す)、B点では、軟磁性下地層4のみが負の方向に反転し、硬磁性下地層3は正方向に磁化しているために、軟磁性下地層4と硬磁性下地層3との磁気的相互作用により、C点では磁界は負であるにもかかわらず、軟磁性下地層4の磁化は正方向に復帰している。

【0034】図4において、本発明の実施例1では硬磁性下地層3の膜厚に係わらず、いずれも負の領域までラインが伸びており、磁気的相互作用が強いことを示している。なお、後述の実施例2の説明において詳細に説明してあるが、軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合膜について、それらの間に交換相互作用または静磁結合を仮定してシミュレーションを行い、MーH曲線を得ているが、この方法により、上述の磁気的相互作用は交換相互作用であることが確認されている。

【0035】つまり、図5に示すように、見掛けのHcは約60eと減磁やスパイクノイズを防止するのに充分大きく、且つ、軟磁性下地層4自体のHc(soft)はそれよりもずっと小さい。その数値は、図4及び以下に示す式で推定できる。つまり、図4において、磁界HによってHm(H)が変化しているのは、硬磁性下地層3の残存磁化が変化しているためであり、横軸が | H | / H c=1の点(Hm(1))では、硬磁性下地層3の磁化変化がほとんど無いと考えられ、軟磁性下地層4の磁化だけが反転した状態であり、このHm(1)と一Hcとの差が軟磁性下地層4のみの場合の抗磁力(Hc(sof

10

Hc (soft) = 
$$\frac{\text{Hm}(1) - (-\text{Hc})}{2} = \frac{\text{Hm}(1) + \text{Hc}}{2}$$

[0037] これより、軟磁性下地層4自体のHc(soft)は、硬磁性下地層3が50nm以上のものではHcの15%(10e)程度、25nmのものでも40%(2~2.50e)程度と評価され、軟磁性下地層4が本来持っている軟磁気特性を保持するのに充分小さい値である。このため、表1に示すように透磁率 $\mu$ 及び再生出力 $E_{r-r}$ は高い値を維持している。これに対し図6に示す比較例2では、軟磁性下地層24そのもののHcが高くなっているため、Hm(H)は常にHcとほぼ等しく、図4のラインが負になることはない(なお、図6において、四角枠内の矢印は、A′、B′、C′、D′各点における磁化の向きを示す)。従って、軟磁気特性が損なわれており、透磁率 $\mu$ が低くなっている。このことと、またCuが添加してあるため、磁束密度が下がっていることで出力が低くなっている。

【0038】なお、本実施例1において、円板状ガラス基板上の硬磁性下地層を一方方向に磁化させるのには、硬磁性下地層を形成するDCマグネトロンスパッタ時の基板の半径方向に印加されている磁界によったが、これに限定されるものではなく、硬磁性下地層を形成後に、半径方向の一方方向に着磁すること等によっても磁化出来る事はいうまでもない。

【0039】〈実施例2〉図10は、本発明の垂直磁気 記録媒体の第2の実施例の構成を模式的に示す部分断面 図である。同図に示すように、垂直磁気記録媒体50 は、鏡面研磨した円板状のガラス基板1と、このガラス 基板1の上に順に形成された硬磁性下地層53、軟磁性 下地層4、垂直磁気記録層5及び保護層6とから構成されている。

【0040】以下、本発明の第2の実施例についてその 具体的な製造方法を説明する。ガラス基板1に形成する 各層53、4、5、6の成膜には、上述の実施例1の製 造に際して使用した図7に示される構造のDCマグネト ロンスパッタ装置を使用した。

【0041】成膜条件は、ガス圧0.067~0.13 40 PaのAr努囲気で、電力密度を0.5~2.0W/cm²、ターゲットー基板間距離を60mm、基板温度を150℃~250℃とした。なお、ターゲット43は硬磁性下地層53用としては、直径203mmのCo上のエロージョンエリアとなるべき近辺に、Smのチップ(サイズ: $5\times5\times1$ mm)を32~48個配置して構成した複合ターゲットを使用した。また、ターゲット43は、軟磁性下地層4用としては、直径203mmのCo-Zr5-Nb4at%合金を使用し、垂直磁気配録層5用としては、同サイズのCo-Cr15-Ta4at 50

%合金を使用し、保護層 6 用として同サイズの $SiO_2$ を使用した。

【0043】次いで、Co-Zr5-Nb4 at%合金をターゲット43として軟磁性下地層4を500nm成膜後、直ちにCo-Cr15-Ta4 at%合金をターゲット43として垂直磁気記録層5を75nm成膜した。ここで直ちに成膜することにより、Co-Zr-Nbと20 Co-Cr-Taとが直接結合し、強く垂直配向する垂直磁気記録層5が得られる。また、成膜中には、マグネトロンの磁石41、42によって、常に約4kA/mの磁界が基板1の半径方向に加えられているので、硬磁性下地層53と軟磁性下地層4の磁化及び磁化容易軸は基板1の半径方向に揃えられる。最後に保護層6としてSiO2を15nm形成した。

【0044】このようにして成膜を終えた後、実施例1と同様の磁界中熱処理を行った。すなわち、10<sup>-3</sup>Pa以下の真空中雰囲気において、24kA/mの磁界中で成膜後の垂直磁気記録媒体50をその回転中心軸の回りに回転させながら、300℃で、3時間の熱処理を行なって、垂直磁気記録媒体50を得た。

【0045】ここで、本実施例2と特性比較するために、上述の実施例1と比較例3を用いた。比較例3の垂直磁気記録媒体は別に製作した。比較例3の垂直磁気記録媒体51は、図11に示すように構成されており、ガラス基板1と、この上に順に形成された軟磁性下地層4、垂直磁気記録層5及び保護層6とからなる。各層4、5、6の材質及び成膜条件は、上述の実施例2の場
の合と同一である。

【0046】次に、これらの試料(実施例2、実施例1及び比較例3)の特性評価結果について説明する。まず、記録再生特性について述べる。なお、これらの試料についての記録再生特性は、トラック幅8 $\mu$ m、主磁極厚0.4 $\mu$ m、コイル巻数60ターンの単磁極ヘッドを用い、ディスク回転数2070rpm、線速度8m/s、ヘッド浮上量80nmの条件で測定を行った。

【0047】100kHzの矩形波信号を配録再生し、 オシロスコープによって孤立波再生出力E,-, (nV/ (μm・t・m/s))を測定した。ここで、再生出力 11

は、トラック幅(µm)、コイル巻数(t)及び線速度 (m/s) で、規格化してある。比較例1に対する比を d Bで表した。6. 67MHzの信号を記録再生し、そ のときのノイズ成分とシステムノイズとの差分を、帯域 16MHzにわたってスペクトルアナライザにより測定 し、媒体ノイズ(μ V...)を得た。比較例1に対する 比をdBで表した。上記の孤立波再生出力E,。。と媒体\* \*ノイズの比をS/Nとし、比較例3に対する比をdBで 表した。また、垂直磁気配録媒体を回転開始した直後の 再生出力と、2×104回転後の再生出力の比を減磁量 (dB) とし、実施例1に対する比をdBで表した。以 上の測定結果を、表2に示す。

12

[0048]

【表2】

<b>特性</b>	再生出力	ノイズ	S/N	減磁量
試料	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
実施例2	0.71	-1.38	2. l	0
実施例1	1.35	1.47	-0.1	0.13
比較例3	0	0	0	4.5

【0049】表2によれば、本発明の実施例2の垂直磁 気記録媒体50は、硬磁性下地層53を有しない比較例 3に対して、再生出力は増加し、媒体ノイズは低下して おり、結果として、S/Nが2. 1dBと大幅に改善さ れている。実施例1は比較例3に対してはS/Nは同等 である。本発明による垂直磁気記録媒体50は、減磁量 については測定限界程度にまで改善されており、減磁量 20 を改善した実施例1と同等である。

【0050】次に、磁気特性について説明する。垂直磁 気記録媒体の磁気特性については、VSMで評価した。 まず、CoSm膜単体の磁気特性を説明する。図15 は、本発明の垂直磁気記録媒体の実施例2における硬磁 性下地層53を構成するCoSm膜単体のM-H曲線を 示す図であり、円板状の基板1の面内について円周方向 と半径方向での測定結果を示す。同図にみるとおり、半 径方向のM-H曲線は、ほぼ1の角型比を示し、一方、 円周方向のM-H曲線は緩やかな傾斜を示す。これよ り、CoSm膜は、半径方向に強く配向していることが わかる。また、Smの組成比11~33at%の範囲内 で同様のM-H曲線が得られており、保磁力Hcは50 ~10000の範囲であった。なお、このCoSm膜 は、上述した硬磁性下地層53の製法と同様に製作され ており、磁界中熱処理も実施されている。

【0051】次に、硬磁性下地層/軟磁性下地層の複合 層のM-H曲線を説明する。まず、硬磁性下地層として CoSm膜を、軟磁性下地層としてCoZrNb膜を用 いたときの複合層のM-H曲線の推定を、磁気的相互作 40 用を考慮したシミュレーションにより行った。図16に は、シミュレーションに用いられたCoSm膜及びCo ZrNb膜単体のM-H曲線を示す。図17は、CoS m膜とCoZrNb膜の複合層について、CoSm膜と CoZrNb膜との間に磁気的相互作用(静磁結合及び 交換結合)がないとしてシミュレーションした結果得ら れたM-H曲線を示している。すなわち、図16中の2 曲線を単純に重ね合わせた結果が得られている。

【0052】一方、図18は、CoSm膜とCoZrN

の間に交換結合の磁気的相互作用のみがあるとしてシミ ュレーションした結果得られたM-H曲線を示してい る。見掛上の保磁力Hcは大きくなっている。また、図 20は、CoSm膜とCoZrNb膜の複合層につい て、CoSm膜とCoZrNb膜との間に静磁結合の磁 気的相互作用のみがあるとしてシミュレーションした結 果得られたM-H曲線を示している。見掛上の保磁力H cは負の値を示している。

【0053】実際の複合膜のM-H曲線を図14に示 す。図14において、(A)は、本発明の垂直磁気記録 媒体の実施例2を構成する、軟磁性下地層/硬磁性下地 層の複合層の間に中間層がある場合のM-H曲線を、

(B) は、本発明の垂直磁気記録媒体の実施例2を構成 する、軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合層のM-H曲 線を、それぞれ示す。なお、硬磁性下地層としてCoS m膜を、軟磁性下地層としてCoZrNb膜を、中間層 としては2nmのSiO2層を、上述の実施例2と同様 に成膜した。

【0054】図14(A)に示すM-H曲線は、図17 に示すM-H曲線と相似であり、中間層の存在により、 CoSm膜とCoZrNb膜の磁気的相互作用が断ち切 られている。一方、図14(B)に示すM-H曲線は、 図18に示すM-H曲線と相似であり、CoSm膜とC o Z r N b 膜との間には強い交換結合が作用しているこ とがわかる。なお、図20に示すM-H曲線の形より、 CoSm膜とCoZrNb膜の間に、静磁結合が単独で は作用していないことがわかる。

【0055】各試料につき、M-H曲線を測定し、軟磁 性下地層/硬磁性下地層の複合層の印加磁界とその磁界 に対応したマイナーループの反転磁界との関係を明らか にした。軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合層のM-H (磁化) 曲線を説明する。まず、図19に示した、複合 層について得られる、印加磁界Hと反転磁界Hmとの関 係を示すマイナーループについて説明する。図19にお いて、横軸は印加磁界Hの強度を、縦軸は磁化Mを、u は飽和磁化曲線(部分)を、vはマイナーループをそれ b膜の複合層について、CoSm膜とCoZrNb膜と 50 ぞれ示す。なお、このM-H曲線の測定は基板1の面内

方向に磁界を印加して行ったので、垂直磁気記録層5が あっても、この垂直磁気記録層5は、基板1面に垂直方 向に強い異方性を持つため、以下に述べる測定結果に影 響を与えない事が分かっている。

【0056】まず、磁化されていない複合層に、正方向に増加する磁界Hを印加すると、図に示されていない初磁化曲線を辿り、正方向に磁化され、硬磁性下地層を正方向に充分飽和する磁界強度であるa点に達し、磁化Mは正方向に飽和する。次に、印加磁界Hを減少させると、磁化Mは曲線 u を辿り減少していく。磁界Hが0に 10達すると、今度は負方向に磁界Hを増加させていく。磁界Hがc点で示すーHc(保磁力)に達すると、磁化Mは0となる。さらに、負方向に磁界Hを増加させると、複合層は負方向に磁化され、磁界Hが一H1になるとり点に達する。

【0057】次に、b点において磁界を反転し、正方向に磁界Hを変化させていくと、M-H曲線はマイナーループを描き、曲線vに沿って磁化Mは変化していく。そして、磁化Mが0となったときのd点で示される磁界HをHm(H1)として求める(Hmを反転磁界とする)。さらに磁界Hを正方向に変化させていくと、正方向に磁化され、再びa点に達する。この操作を繰り返し、印加磁界Hと反転磁界Hmとの関係を求めた。

【0058】図12に、本発明の実施例2である、硬磁性下地層2が半径配向したCo-Smのときの軟磁性下地層3/硬磁性下地層2の複合層の、印加磁界Hとその磁界に対応したマイナーループの反転磁界Hmとの関係を、実施例1と共に示す。本実施例2においては、Hが50Oe(4kA/m)まではHmは負の一定の値を示している。この事は、媒体の保存状態において、50O 30eより小さな磁界が硬磁性下地層53の磁化と反対方向に仮に加わっても、磁界を0に戻せば再び元の磁化状態に復帰することを示している。

【0059】一方、実施例1の軟磁性下地層3/硬磁性下地層7の複合層では、印加磁界Hに対してHmは単調に変化しており、これは、媒体保存時に、反対方向に保磁力をわずかに越える磁界が加わると、元の磁化状態には復帰せず、媒体を使用するときに、減磁、スパイクノイズを引き起こす危険性のあることを示すものである(もちろん、上述の実施例1で説明したように、従来例 40に対しては、保磁力そのものが遥かに大きくなっており、減磁が改善されていることは明白である)。

【0060】次に、硬磁性下地層53、3の結晶性をX線解析法によって調べた結果について説明する。図13は、本発明の垂直磁気記録媒体の実施例1及び実施例2の垂直磁気記録媒体のX線回折パターンを示す図である。同図に示すように、実施例1の硬磁性下地層3においては、bcc-Cr及びhcp-CoCrTaの明確なピークが観測され、明らかに結晶質である事がわかった。一方、本実施例2の硬磁性下地層53においては、

CoSmからのピークは観測されず、これより硬磁性下 地層53は、非晶質もしくは微結晶質であることがわか った。なお、回折には、Cuターゲットを使用し、実施 例2の場合は、回折ピークを確認するために、実施例1

に対し4倍のターゲット電流を流した。

【0061】さらに、走査型電子顕微鏡(SEM)によって、単独に基板1上に作製された硬磁性下地層53、3の薄膜表面を観察したところ、実施例1の硬磁性下地層3については、明瞭な結晶粒が観察されたのに対し、本実施例2の硬磁性下地層53のCoSmには、結晶粒は見られず、表面も平滑である事がわかった。

【0062】なお、使用する硬磁性下地層53の磁気特性および膜厚の範囲は、軟磁性下地層4の磁気特性、膜厚との関連で決定され、図12に示したカーブにおいて、Hmが立ち上がる磁界が外来磁界に比べて充分大きくなるように、例えば500A/m以上になるように設定すればよい。

[0063]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1による本発明の垂直磁気記録媒体によれば、円板状の基板と、この基板上に形成された軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直磁気記録層とを備えた垂直磁気記録媒体において、前記基板と前記軟磁性下地層との間に、全ての磁化方向が前記基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいずれかである磁化を有する硬磁性下地層を設けた事により、媒体の回転による減磁を防止し、媒体ノイズを低減し、高い再生出力を得ることが出来、それにより、高性能且つ高品質な垂直磁気記録媒体を提供する事が出来る。

【0064】また、請求項2による本発明の垂直磁気記録媒体によれば、円板状の基板と、この基板上に形成された軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直磁気記録層とを備えた垂直磁気記録媒体において、前記基板と前記軟磁性下地層との間に、全ての磁化方向が前記基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいずれかであって配向方向が前記基板の面内である面内配向硬磁性下地層を設けた事により、媒体の回転による減磁を防止し、媒体ノイズを低減し、高い再生出力を得ることが出来、それにより、高性能且つ高品質な垂直磁気記録媒体を提供する事が出来る。

【0065】また、請求項3による本発明の垂直磁気記録媒体によれば、円板状の基板と、この基板上に形成された軟磁性下地層と、この軟磁性下地層上に形成された垂直磁気記録層とを備えた垂直磁気記録媒体において、前記基板と前記軟磁性下地層との間に、全ての磁化が前記基板の半径方向の外周向き或いは中心向きのいずれかであって配向方向が前記半径方向である半径配向硬磁性下地層を設けた事により、媒体の回転による滅磁を防止し、媒体ノイズを低減し、高い再生出力を得ることが出50来、それにより、高性能且つ高品質な垂直磁気記録媒体

を提供する事が出来る。

【0066】また、請求項4による本発明の垂直磁気記録媒体によれば、請求項3に記載の垂直磁気記録媒体であって、前記半径配向硬磁性下地層をSm(サマリュウム)を含むCo合金膜とした事により、媒体の回転による減磁を防止し、媒体ノイズを低減し、高い再生出力を得ることが出来、それにより、高性能且つ高品質な垂直磁気記録媒体を提供する事が出来る。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の垂直磁気記録媒体の第1の実施例の構 10 成を模式的に示す部分断面図である。

【図2】第1の比較例の垂直磁気記録媒体の構成を模式 的に示す部分断面図である。

【図3】第1の従来例及び第2の比較例の垂直磁気記録 媒体の構成を模式的に示す部分断面図である。

【図4】 軟磁性下地層/硬磁性下地層のM-H曲線における規格化した印加磁界H/HcとマイナーループのHm(H)との関係を示すグラフ図である。

【図5】本発明の垂直磁気記録媒体の第1の実施例を構成する軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合層のM-H曲 20線を示すグラフ図である。

【図6】第2の比較例の垂直磁気記録媒体を構成する軟 磁性下地層のM-H曲線を示すグラフ図である。

【図7】 垂直磁気記録媒体の製造に使用されるDCマグネトロンスパッタ装置のターゲット電極付近の構成を示す概略断面図である。

【図8】垂直磁気記録媒体の製造工程の1つである磁界中熱処理を説明するための概念図である。

【図9】第2の従来例の垂直磁気記録媒体の構成を模式 的に示す部分断面図である。

【図10】本発明の垂直磁気記録媒体の第2の実施例の 構成を模式的に示す部分断面図である。

【図11】第3の比較例の垂直磁気記録媒体の構成を模式的に示す部分断面図である。

【図12】本発明の垂直磁気記録媒体の第1及び第2の 実施例の垂直磁気記録媒体を構成する軟磁性下地層/硬 磁性下地層の複合層の、印加磁界Hとその磁界に対応し たマイナーループの反転磁界Hmとの関係を表すグラフ 図である。

【図13】本発明の垂直磁気記録媒体の第1及び第2の 40 実施例の垂直磁気記録媒体のX線回折パターンを示す図 である。

【図14】本発明の垂直磁気記録媒体の第2の実施例を 構成する、軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合層の間に 中間層がある場合とない場合のM-H曲線を示す図であ る。

【図15】本発明の垂直磁気配録媒体の第2の実施例における硬磁性下地層2を構成するCoSm膜単体のM-H曲線を示す図である。

【図16】本発明の垂直磁気記録媒体の第2の実施例を 構成する軟磁性下地層と硬磁性下地層それぞれについ て、シミュレーションした結果得られたM-H曲線を示 す図である。

16

【図17】本発明の垂直磁気記録媒体の第2の実施例を構成する、軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合層について、軟磁性下地層と硬磁性下地層との間に磁気的相互作用がないとしてシミュレーションした結果得られたMーH曲線を示す図である。

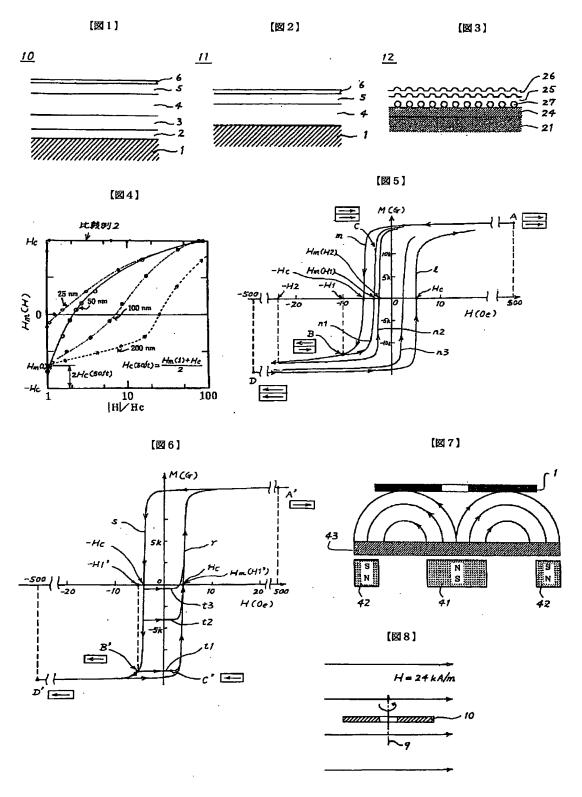
10 【図18】本発明の垂直磁気配録媒体の第2の実施例を 構成する、軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合層につい て、軟磁性下地層と硬磁性下地層との間に交換相互作用 があるとしてシミュレーションした結果得られたM-H 曲線を示す図である。

【図19】印加磁界Hと反転磁界Hmとの関係を説明するためのマイナーループを示す図である。

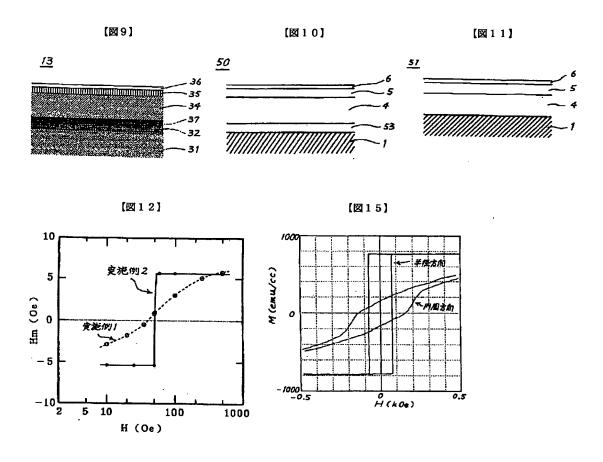
【図20】本発明の垂直磁気記録媒体の第2の実施例を 構成する、軟磁性下地層/硬磁性下地層の複合層につい て、軟磁性下地層と硬磁性下地層との間に静磁結合があ るとしてシミュレーションした結果得られたM-H曲線 を示す図である。

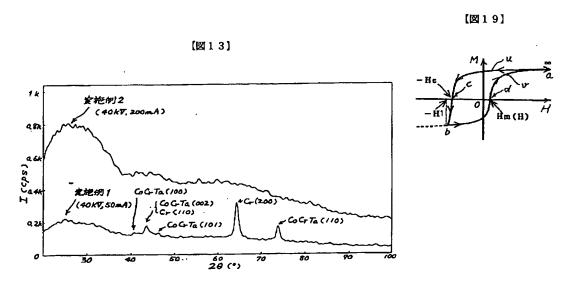
【符号の説明】

- 1 円形基板
- 2 クロム層
- 3 硬磁性下地層
- 4 軟磁性下地層
- 5 垂直磁気記録層
- 6 保護層
- 9 回転中心軸
- 30 10 垂直磁気記録媒体(実施例1)
  - 11 垂直磁気記録媒体(比較例1)
  - 12 垂直磁気記録媒体(従来例1)
  - 13 垂直磁気記録媒体(従来例2)
  - 21 ガラス基板
  - 24 軟磁性下地層
  - 25 垂直磁気記録層
  - 26 保護層
  - 31 ガラス基板
  - 32 クロム層
  - 34 軟磁性下地層
  - 35 垂直磁気記録層
  - 36 保護層
  - 37 カーポン層
  - 41 第1の永久磁石
  - 42 第2の希土類永久磁石
  - 43 ターゲット
  - 50 垂直磁気記録媒体(実施例2)
  - 51 垂直磁気記録媒体(比較例1)
  - 53 硬磁性下地層

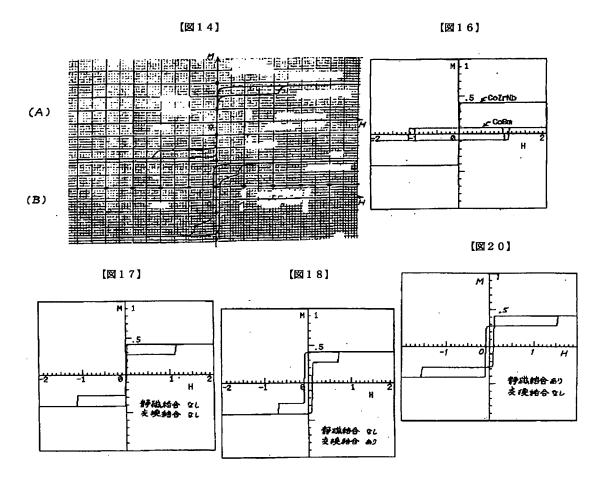


Patent provided by  $Sugh_{392}\underline{Mi}$ on, PLLC - http://www.sughrue.com





Patent provided by  $Sugh_{3}Mlon$ , PLLC - http://www.sughrue.com



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☑ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: \_\_\_\_\_

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.